

フォトニクスセンター共用装置一覧

装置G	装置名	設置場所	講習会 有無	グループ利用料 (年間)	装置別利用料 (時間)	消耗品負担 有無
設計	構造設計ソフト	P3-205	×	¥13,000	-	×
	光学系設計ソフト	P3-205	×			×
	機械加工プログラム作成ソフト	P3-207	×			×
微細加工	ナノインプリント装置	P3-517	○	¥10,000	-	×
	ワイヤーボンダー	P3-517	○			×
表面評価	表面段差計	A1-215	○	¥10,000	-	×
	レーザー干渉計	A1-219	×			×
光学測定	共焦点レーザー顕微鏡	P3-309	○	¥30,000	-	×
	倒立顕微鏡	P3-309	×			×
	マイクロプレートリーダー	P3-309	○			×
	エリプソメーター	A1-215	○			×
	デジタルマイクロスコープ	A1-215	×			×
	マルチチャンネル分光器	A1-219	○			×
	紫外可視近赤外分光光度計	A1-215	○			×
分析	サーマルサイクラー	P3-309	×	¥15,000	-	×
	ゼータ電位計	P3-309	○			× (*1)
	ポテンショスタット	P3-309	×			×
	ナノサイト	A1-219	○			×
機種毎	3Dプリンター	P3-205	○	-	¥3,000	○
	マスクレス露光装置	P3-517	○	-	¥500	× (*2)
	集束イオンビーム加工・観察装置	A1-215	○	-	¥3,200	×
	コンパクトスパッタ	A1-215	○	-	¥1,500	×
	広視野ラマン顕微鏡	P3-309	○	-	¥1,300	×
	レーザーラマン顕微鏡	P3-309	○	-	¥1,300	×
	SEM-EDX	A1-215	○	-	¥1,000	×
	走査型プローブ顕微鏡	P3-309	○	-	¥1,000	× (*3)
	プラズマクリーナー	P3-517	○	-	¥1,000	×
	蛍光分光光度計	P3-309	○	-	¥500	×
	顕微FT-IR	P3-309	○	-	¥1,500	×
その他 申請不要	スピンコーター	P3-517	×	-	¥0	×
	マイクロトーム	A1-215	×	-	¥0	×
	プラチナコーター	A1-215	×	-	¥0	×
	ドラフト	P3-309	×	-	¥0	×
	超純水製造装置	P3-309	×	-	¥0	×
	製氷機	P3-309	×	-	¥0	×
	分析天秤	P3-309	×	-	¥0	×
	pH測定器	P3-309	×	-	¥0	×
	オシロスコープ	P3-205	×	-	¥0	×
	実体顕微鏡	A1-219	×	-	¥0	×

(*1):セルは持参のこと (*2):レジストは持参のこと (備え付けレジストもあり) (*3):カンチレバーは持参のこ